402187045 A JUL 1990

# Best Available Copy

(54) JUNCTION PAD OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

(11) 2-187046 (A)

(43) 23.7.1990 (19) JP

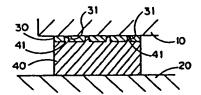
(21) Appl. No. 64-7354 (22) 13.1.1989

(71) MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (72) YOSHINOBU MOMOI

(51) Int. Cls. H01L21/60

PURPOSE: To make a bump and a pad have a state that they engage each other on the occasion of performing thermocompression bonding and increase a substantial junction area to improve mechanical, electrical junction performance by providing an uneven part for reinforcement of junction at a face where pad and bump junction is performed.

CONSTITUTION: A pad 30 is provided at a semiconductor element 10 and holes 31 are formed into recessed shapes on the surface of its element in every direction at equal intervals. The pad 30 is pressed thermally on a bump 40 of a package substrate 20 with thermocompression bonding means. A part of the bump 40 which melts and softens through thermocompression goes into the inside of each hole 31 of the pad 30. Then protrusions 41 are formed in such a state that the holes 31 and the protrusions 41 engage with each other. The surfaces of the above holes and protrusions are added to a junction area. Such state of this element not only makes a substantial junction area large but also increases a resistance to shearing stress in the horizontal direction.



#### 平2-187046 四公開特許公報(A)

Mint. Cl. 3

on in the self

(j)

庁内整理番号 識別配号

❸公開 平成2年(1990)7月23日

H 01 L 21/60

6918-5F 311 S

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

半導体素子の接合用パツド ❷発明の名称

> 頭 平1-7354 创特

願 平1(1989)1月13日 20出

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 姓 宜 @発 明 者

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地 の出頭の人

弁理士 松本 武彦 10代 理 人

#### 1. 発明の名称

半導体素子の接合用パッド

#### 2. 特許請求の範囲

- 1 半導体素子を基材に搭載する際に、基材の 表面に設けられたパンプとの接合個所に設けられ るパッドにおいて、パンプとの接合面に接合強化 用凹凸部が設けられていることを特徴とする半導 休粜子の接合用パッド。
- 2 接合強化用凹凸部が、接合面に縦機に形成 された格子状凹凸部である請求項1記載の半導体 **粜子の投合用パッド。**
- 3 接合強化用凹凸部が、基材と半導体素子と の熱脚褒差によって発生する剪断力の方向と直交 する方向に沿って接合面に投けられた複数の平行 線状凹凸部である請求項1記載の半導体業子の接 合用パッド。
- 4 接合強化用凹凸部が、接合面に突出形成さ れた複数の突起である請求項1記載の半導体素子 の接合用パッド。

#### 3. 発明の群組な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体素子の接合用パッドに関し 、詳しくは、半導体素子をパッケージ店材や配線 基版等の基材に搭載する際に、基材側に設けられ たAu等からなるパンプとの接合を行うために、 半導体素子の表面に設けられるパッドに関するも のである。

#### (従来の技術)

半導体素子(チップ)は、通常、合成樹脂やセ ラミック等からなるパッケージ店材に搭載されて パッケージ化され、この半導体パッケージに設け られたリードや娘子ピンを、配紋基板の回路上に ^ 直接またはスルーホールを用いて接合して使用す るようになっている。

このような半導体パッケージの1種として、例 えば、角板状のパッケージ基材に半導体素子を搭 載するとともに、パッケージ基材の下面に多数の 強子ピンを並べて設けたPGA(ピン・グリッド ・アレイ) パッケージがある。この P G A パッケ

. )

第7図および第8図は上記したようなワイヤレスPGAパッケージの構造を例示している。第7図は、半導体素子1とパッケージ基材2とを接合する前の状態を示しており、半導体素子1の下面には、所定の各電極に対応するパッド1aが複数個並んで設けられている。パッケージ基材2の上面には、半導体素子1のパッド1aに対応する位

1. 1. 11

選に、それぞれパンプ2 a が扱けられているとともに、パッケージ基材2の下面には、配積基板等のスルーホールに挿入するための値子ピン2 b が多数投けられている。半導体素子1をパッケージ基材2に搭載するには、半導体素子1の各パッド1 a をパッケージ基材2のパンプ2 a に対応する合わせた状態で加熱と同時に加圧することによって、各パンプ2 a とパッド1 a を熱圧着させて投合一体化するようになっている。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところが、前記した従来における半導体素子の 接合用パッド 1 a は、パンプ 2 a との接合強度が 充分でなく、パッド 1 a とパンプ 2 a の接合不良 を起こしたり、剝離による断線を起こすという問 題があった。

例えば、半導体素子1をパッケージ基材2に基 載して使用中に、大きな温度変化があると、半導体素子1のシリコン基板等とセラミック等からな るパッケージ基材2とは熱脳張係数が大きく違っ ているので、熱脳張に伴って半導体素子1とパッ

ケージ素材 2 の接合面、すなわち、パッド 1 a とパンプ 2 a の接合面に沿って水平方向の剪断力が働くことになる。従来のパッド 1 a は、パンプ 2 a との接合面が平坦な面に形成されているので、上記水平方向の剪断力に対する抵抗力すなわち水平剪断強度が小さく、比較的小さな力で接合面が剝がれてしまい、パッド 1 a とパンプ 2 a の接合不良や剝離(断線)を生じてしまうのである。

半導体素子1のパッド1aとパッケージ基材2aのパンプ2aとの機械的および電気的な接合性 他を向上させるには、パッド1aとパンプ2aの 接合面積が広い程好ましいのであるが、高集積化 および小型化が要求される半導体装置においては 、パッド1aとパンプ2aの平面的な投置面積 大きくすることには限界があり、単純に平面形状 を大きくすることでパッド1aとパンプ2aの接 合面積を増大することは実用的な方法ではない。

そこで、この発明の課題は、前記したような半 導体素子の接合用パッドにおいて、パッドの平面 的な面積を増大することなく、パンプとの実質的 な投合面積を大きくできるとともに、熱影張等に 伴う水平方向の剪断力に対する耐久性を高めることができ、パッドとパンプの接合性能を向上させることができるものを提供することにある。

#### (課題を解決するための手段)

上記課題を解決する、この発明にかかる半導体素子の接合用パッドのうち、請求項1記載の発明は、半導体素子を基材に搭載する際に、基材の表面に設けられたパンプとの接合個所に設けられるパッドにおいて、パンプとの接合面に接合強化用凹凸部が設けられているようにしている。

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明に おいて、接合強化用凹凸部が、接合面に収積に形成された格子状凹凸部であるようにしている。

構求項3記載の発明は、請求項1記載の発明において、接合強化用凹凸部が、基材と半導体素子との熱膨張差に伴って発生する剪断力の方向と直交する方向に沿って投けられた複数の平行線状凹凸部であるようにしている。

請求項 4 記載の発明は、請求項 1 記載の発明に

おいて、接合強化用凹凸部が、接合面に突出形成 された複数の突起であるようにしている。

(作 用)

. :

請求項1記載の発明によれば、パッドの接合面 に接合強化用凹凸部を投けておくことによって、 3. パンプに熱圧着したときに、溶融または軟化した パンプの一郎がパッドの前記凹凸部の凹部に入り こむか、または、同凹凸部の凸部がパンプに食い 込むかして、パンプとパッドとが互いに陥み合っ た状態で接合されることになる。そのため、パッ ドの平面的な改置面積が同じであっても、前記凹 凸部を含む全衷面積に相当する実質的な接合面積 は大幅に増大することになり、かつ、互いの哈み 合いに伴う固定力の発生もあって、パッドとパン プの接合性能が大いに向上する。 特に、パッドと パンプとが前記凹凸部で喰み合わされた状態で接 合されていることにより、前記したような使用中 の熱膨張差等による水平方向の剪断力が加わった ときに大きな抵抗力を発揮することができる。

請求項2記載の発明によれば、パッドとパンプ

の接合面において、水平方向の何れの方向に剪断力が加わっても、格子を構成する各線状の凹部または凸部の何れかが、大きな抵抗力を発揮することになる。

請求項3記載の発明によれば、平行線状凹凸部 が、熱膨張差に伴って生じる剪断力の方向に直交 して大きな抵抗力を発揮することになるので、接 合不良や射離の大きな原因となる前記剪断力の方 向に対して効率的に接合力を強化できる。

構求項 4 記載の発明によれば、パッドに設けらられた突起がパンプの内部に入り込んだ状態になるので、突起によってパンプを補強できるとといい加熱および加圧によってパッドとパンプの後合性能の向上作用のある、パッドとパンプの接合性能をより向上させることができる。

(実 施 例)

ついで、この発明を、実施例を示す図面を参照

しながら以下に詳しく説明する。

٠., .

第1図および第2図は、前記したようなワイヤレスPGAパッケージの、半導体素子10とパッケージ基材20の接合に関係する部分のみを示している。半導体素子10およパッケージ基材20の全体的な構造や形状は、前記した第7図および第8図の従来例等、通常の半導体パッケージと同様であるので、詳しい説明は省略する。

シリコン基板等からなる半導体素子10には、 の位置に複数のパッド30が設けられている。パッド30は過常の半導体素団路を構成すると 同様に、半導体素子10の導体は固定を構成四次では、半導体素等のである。各別のでは、10ので の熱圧者手段で、パッケージ基材 2 0 のパンプ 4 0 に熱圧者する。パンプ 4 0 は、A 4 • O • セラミック等からなるパッケージ基材 2 0 の導体国路につながる、前記パッド 3 0 との接合位置に、 A u 等の導体金属を島伏に盛り上げるようにして設けられており、パンプ 4 0 の表面は従来と同様に平坦に形成されている。

### 特閒平2-187046 (4)

次31の形状や深さは、必要とされる接合力とパッド30の大きさや半導体素子10の構造等によって通当に投定されるが、例えば、縦120m×積120mの穴31を、縦横00間隔ピッチ20mで合計25個投けるのが、その一例である。穴31の形状は、円筒状のものが加工しあいため好ましいが、円筒以外に、長円形、角形をの他の形状でも実施できる。穴31の配置するほか、千鳥状に配置したり、外周と中央で配置間隔を変えたりすることもできる。

つぎに、第3図には上記と異なる実施例を示している。すなわち、パッド30の衷面に、接合強化用凹凸部として多数の平行凹溝32を設けている。そして、この平行凹溝32の形成方向を、半導体素子10に対するパッド30の形成位置によって変えている。すなわち、何れのパッド30においても、半導体素子10とパッケージ基付20との間に熱影張差に伴って発生する剪断力の方向

(矢印×で示している) に対して直交する方向に 沿って平行四級 3 2 を扱けようにしているのであ る。

半導体素子10とパッケージ基材20との熱膨 張芝に伴う剪断力は、半導体量子 1 0 およびパッ ケージ基材20の中心から外周側に向かって放射 方向に生じるので、半導体素子10の各所に設け られたパッド30には、それぞれの位置によって 、剪断力の加わる方向(矢印X)が異なることに なる。そこで、それぞれのパッド30に対して、 その位置における剪断力方向Xと直交するように 平行四溝32を及けておけば、剪断力に対して基 も大きな抵抗力を発揮することができ、パッド3 0とパンプ 4 0 の接合力の向上を最も効率的に行 うことができるのである。図示した実施例では、 半導体素子10の図中左上隅および右下隅のパッ ド30(拡大表示した部分に相当)では、右上が り45。で傾斜した平行四端32が設けられ、た 下隅および右上隅のパッド30には、右下がり4 5 で傾斜した平行四溝32が投けられ、左右辺。

中央のパッド30は上下方向に沿って平行四端3 2が改けられ、上下辺中央のパッド30は左右方 向に沿って平行四端32が投けられている。

平行凹溝32の溝幅や形成本数は、必要に応じて通当に設定されるが、例えば、前記実施例と同様の120×120×120ペッド30に対して、中央の80×80×00短囲に、溝幅1mで間隔29×00平行凹溝32を設けるのが、その1例である。

つぎに、第4図はさらに別の実施例を示しており、この実施例の場合、パッド30の表面に対して、環機の格子状凹調33を設けている。この緩緩の格子状凹調33であれば、水平方向の剪断力がパッド30の何れの方向に向かって加わっても、これに対して同じように良好な抵抗力を発揮することができる。なお、格子状凹調33の緩もしくは機方向の凹端が、前記熱脳張に伴う剪断力の方向×と直交するように格子状凹端33を設けておけば、剪断力に対する抵抗力がより向上する。

つぎに、第5四および第6図に示す実施例では

、パッド30の表面に、前記実施例のような穴3 1の代わりに、円柱形の突起34が設けられてい る。この突起34を備えたパッド30をパンプ4 0に熱圧着すると、加熱軟化されたパンプ40に 突起34が入り込み、パンプ10に突起34に対 応する凹部11が形成されて、この突起34と凹 郎44とが互いに喰み合った状態で接合される。 このように、パッド30の突起34がパンプ40 の内部に入り込んだ状態になると、比較的柔らか く強度に劣るパンプイ0が突起34で補強される ことになるとともに、パッド30とパンプ40と の鳥圧者過程で、互いの接合面に生成し接合性能 にとって重要な作用を果たす、両者の構成金属材 料からなる合金層が、突起状凹部34からパンプ 4 0 の内部へと大きく広がって形成され、パッド 30とパンプ 40の接合性能をより向上させるこ とができる。

突起34の具体的な形状寸法や配置は、必要とされる接合力とパッド30の構造等の条件によって通当に設定されるが、例えば、前記した120

× 1 2 0 × 1 mのパッド 3 0 に対して、図示した ような形状および配置で、直径 5 mで高さ 1 0 m の円柱状の突起 3 4 を 5 個、互いの間隔を 4 0 m に配置するのが、その一例である。

突起34の形状は、図示した円柱状のもの以外にも、角柱状その他の任意の形状とすることができる。パッド30の表面に突起34を形成するには、薫着法等の手段が用いられる。

 合、第3図や第4図に示した直線状のもののほか、多数の同心円を直ねたものや、渦巻き状、波形状等の曲線状のものでも実施できる。格子状凹凸部は、基盤目状の格子形状のほか、六角形の蝶の巣状の格子や、小さな円形を密接させた円形格子等でも実施できる。さらに、穴や突起等と線状あるいは格子状の凹凸部とを組み合わせて実施することも可能である。

パッド30の表面に接合強化用凹凸部を形成する手段としては、凹部の場合には、エッチング等の化学的加工手段やレーザー加工等の物理的加工手段等が採用でき、凸部の場合にも、前記した蒸 者法その他の薄膜形成手段や写真製版技術等を追 用することができる。

この発明にかかる半導体業子の接合用パッド3 0は、図示したワイヤレスPGAパッケージへの 半導体業子10の搭載だけでなく、パッド30と パンプ40の接合を必要とする各種の半導体業子 の搭載および接合、あるいは各種の半導体パッケージの製造に適用することができる。

#### (発明の効果)

· .

ale se 🏄

構求項2記載の発明によれば、さらに、パッド に設ける接合強化用凹凸部が、半導体素子と基材 との熱脳張差に伴って発生する剪断力の方向と直 交する方向に沿って設けられた線状凹凸部である ので、上記剪断応力に対する抵抗力が効率的に作用し、パッドとパンプの接合力が一層大きくなって接合性能を向上させることができる。したがって、半導体装置を使用中に大きな温度変化があるような用途に通用しても、パッドとパンプが剝がれたり接合不良を起こすことなく、良好に使用することができるようになる。

開求項3記載の発明によれば、接合強化用凹凸部が格子状凹凸部であるので、パッドの疑債の何れの方向に対しても高い接合力を発揮できる。したがって、パッドとパンプとの間に加わる剪断力の方向が不明であったり異なる方向成分を有する勢断力が加わる可能性のある場合にも、良好な接合性能を発揮することができる。

構求項人記載の発明によれば、接合強化用凹凸 部がパッドの表面に突出する突起であるので、こ の突起がパンプの内部に入り込んでパンプを補強 する効果があるとともに、パッドとパンプの接合 面に生成される合金層が、パッドの凸部からパン プの内部まで大きく広がって、この合金層による

#### 特別平2-187046 (6)

第 1 図

10

. 1

.31

接合力の向上作用を効果的に利用することができ 、パッドとパンプとの接合性能をより高めること ができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

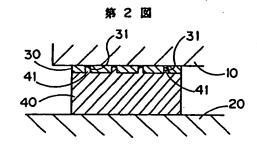
100

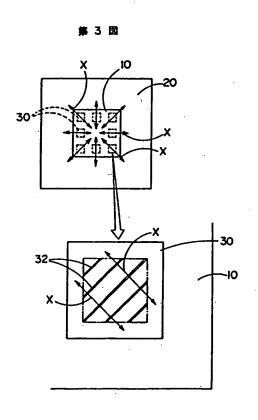
13 14 14 14

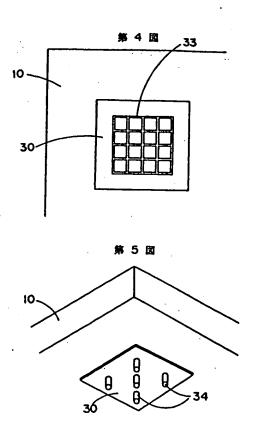
第1図はこの発明にかかる実施例の半導体素子のパッド部分を示す部分平面図、第2図はパッドとバンプの接合状態を模式的に示す部分断面図、第3図は別の実施例における全体構造とパッド部分のみを取り出した状態を示す平面図、第4図は別の実施例における半導体素子のパッド部分を示す部分斜視図、第5図は別の実施例における半導体素子のパッド部分を示す部分斜視図、第6図はパッドとバンプの接合状態を模式的に示す部分断面図、第7図は従来例の全体斜視図、第8図は接合後の側面図である。

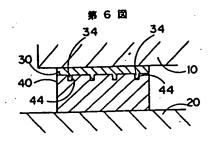
10…半導体素子 20…基材 30…パッド 31~34…接合強化用凹凸部 40…パンプ

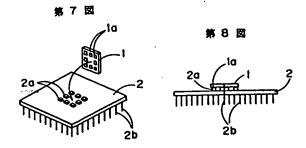
代理人 弁理士 松 本 武 彦











# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.